SPring-8 兵庫県ビームラインにおける 位相ゾーンプレートを用いたマイクロビーム光学系の開発と応用

篭島 靖(姫路工業大学大学院理学研究科)

1.はじめに

X線マイクロビームは、"サブミクロン"のビームサイズが今や日常的になってしまっている。SPring-8 に代表される低エミッタンス・高輝度リングの存在が不可欠であることには疑う余地はないが、ゾーンプレートをはじめとするX線光学素子の進歩の寄与も非常に大きい。本稿では、電子ビームリソグラフィー法で製作された位相ゾーンプレートを用いたマイクロビームについて、その性能評価および幾つか応用例について報告する。

2.ゾーンプレートの性能 - 空間分解能と回折効率 -

ゾーンプレート(ZP)は、X線に対して透明・不透明の輪帯を交互に繰り返した円形の透 過型回折格子である。不透明部分を半透明にして π だけ位相差を加えることにより、回折効率 を向上させることができる。これが位相 ZP である。図1に ZP の模式図を示す。軟X線領域 では、ニッケルやゲルマニウム等の軽金属が用いられ、硬X線ではタンタルや金などの重金 属が用いられている。硬X線領域では δ βなので、不透明部分の寄与が相対的に大きくなり、 結果として比較的高い回折効率が期待できる。タンタル製 ZP の回折効率の計算例を図2に示 す[1] タンタルの厚さを 2.4 μ m にすれば、10 keV において最大 26.1%の回折効率が得られ、 その場合エネルギーが 30 keV に達しても 11%という振幅 ZP と等しい回折効率が得られる。 そもそも ZP は軟X線用に開発された光学素子であったが、重元素を用いることによりむしろ 硬X線に適した光学素子であることが最近認識されつつある。



図1. ゾーンプレート(ZP)の形式と回折効率. 左;振幅 ZP、右;位相 ZP.



このような高い回折 効率を達成するには 2.4 µm という厚さの輪帯を 形成しなければならな いが、一方で ZP の空間 分解能は最外輪帯高いな でが解能るために高いで きるだけ幅の狭い輪帯 を作製しなければなら ない。現在加工技術上ア スペクト比の上限が 10 程度であるため[2] 2.4

図2.タンタル製 ZP の回折効率.(a)厚さ依存性と(b)エネルギー依存性.

μm という厚さにこだわると空間分解能の上限が 0.3 μm 程度に制限されてしまう。すなわち、 空間分解能と回折効率の両立は技術的に困難であり、いずれを重視するかは顕微鏡の設計者 の判断に委ねられる。現在最外幅 50 nm の ZP が開発され、結像型の X 線顕微鏡に用いられて いる [3]

<u>3.兵庫県ビームライン(BL24XU)のX線マイクロビームの現状</u>

BL24XUでは、NTTアドバンステクノロジ社製のタンタル製位相ゾーンプレート[2]をX 線レンズに用いている。そのパラメータを表1に示す。第一ステップとして300 nmのビー ムサイズを目標にOZP1を設計・製作した。SPring-8の光源パラメータからZPがコヒーレン トに照明されるように設計したが、回折限界のビームサイズは得られていない。その理由と しては、光源の揺動、トロイカ方式のために光路中に設置されたダイヤモンド結晶による波 面の乱れ、ベリリウム窓による波面の乱れ、シリコン分光結晶の不完全性・冷却水による振 動等が考えられるが、正しい原因はまだ掴んでいない。図3にマイクロビーム光学系を示す。 縦方向は光源自身でほぼ回折限界の条件を満たしているので、横方向のみスリットを入れて 入射ビームに角度制限をかけている。試料を機械的に2次元走査しながら、試料からの信号 (蛍光X線、透過強度等)を取得しコンピュータで画像化する走査型X線顕微鏡システムで ある。

表1.タンタル製 ZP の主要パラメータ.

| パラメータ | OZP1 | OZP3 |
|-------------------------------|-----------------|------|
| r ₁ (μm) | 5.0 | 3.0 |
| $r_{\rm N}$ (μ m) | 50 | 90 |
| $\Delta r_{\rm N} ({\rm nm})$ | 250 | 50 |
| f @ 10 keV (mm) | 201.6 | 72.6 |
| Ta thickness (µm) | 2.4 | 0.8 |
| Center stop;cs | 5.6-µm- gold | _ |
| r _{cs} (µm) | 22.4 | — |
| 回折効率(理想値) @ 10 keV (%) | 26.1 | 7.4 |



図3.BL24XUの走査型X線顕微鏡システム.

これまでに達成できているビームサイズは、OZP1 で 0.65 μm(縦) × 1.11 μm(横) OZP3 で 110 nm(縦) × 350 nm(横) である。ビームサイズは実験の度毎に多少異なり、これは電 子ビームのバンチ構造に由来するものと考えている。また、フラックス密度は~10⁹ photons/μm²/s であり、利得(ZP が無い場合と比較しての同一面積における強度の比率)は約 3000 である。

4. 蛍光X線分析による毛髪断面の元素マッピングと定量分析

毛髪断面を試料とし、微量元素の空間マッピングと定量分析を試みた。定量分析には薄膜 検量法を適用し、標準試料として抵抗加熱式真空蒸着装置により数種類の厚さの薄膜を作製 した。対象元素は銅のみである。バックグランドをできるだけ抑えるために、基板にはマイ ラー膜(4μm厚)を用いた。SSD は水平面内で入射ビームに対して直角方向に配置し、試料 は入射ビームに対して5度傾けた。また、SSD にアルミ製コリーメータを取り付け、散乱成 分の進入を極力抑えた。図4に、得られた銅薄膜の MCA スペクトルを示す。入射光のエネ ルギーは 10 keV で、積分時間は 400 秒である。基板のみ (0 nm)のスペクトルから、バック グランドが極めてゼロに近いことがわかる。空気中のアルゴンのピークが検出され、またわ ずかに鉄のピークが観測されているが、これは装置周りのバックグランドと考えられる。 $Cu-K\alpha$ 線のグロスカウントをプロットして検量線を作成した。検出限界は約6アト(10⁻¹⁸) グラムと見積もられた。これは銅原子約6万個に対応する。このスペクトルを取った条件と 同じ条件で、毛髪断面(40 µm 厚)について走査型顕微鏡測定を行い、カルシウム、銅、亜 鉛の二次元元素マッピングを取得し、銅については定量二次元マッピングを得た。その結果 を図5に示す。毛髪中の銅の濃度は10~40 ppm 程度と見積もられ、これはICP 質量分析法で 分析した結果とおおまかには一致しており、この定量分析は比較的良好な分析値を与えてい ることが確認できた。尚、濃度 40 ppm は絶対量で約 1.2 フェムトグラム (fg) に対応する。 マイクロビームであれば微小部のみの励起になるので、バックグランドの低減に有効であり、

従って検出限界の観点から全反射法と比較しても決して遜色のない値が期待できる。



図4. 銅薄膜の MCA スペクトル. 積分時間は 400 秒、入射X線のエネルギーは 10 keV(矢印)である。縦軸は対数表示のためゼロカ ウントのデータは間引いてある。銅5 nm は 26 fg に対応する。



図5.毛髪断面中の銅の定量マッピング. 100×100 pixels (125 µm/pixel)、1s/pixel.試料は露 光中水平方向に連続駆動(0.0625 µm/s).

5.将来の展望

SPring-8 の登場によりサブミクロンが常識となり、120 nm のマイクロビームも実現され[4]、 微小領域の研究もサブ 100 nm が視野に入りつつある。しかしながら、例えば極微量元素の蛍 光 X 線分析を例に取れば、ビームサイズが小さくなることは励起される原子数が少なくなる ことを意味しており、サブ 100 nm を目指す場合にはそれ相応の輝度を有する光源が必要とな るであろう。輝度 B (photons/s/mrad²/mm²/0.1%b.w.)の光源で得られる波長 λ の光子のコヒ ーレントフラックス F_c (photons/s/0.1%b.w.) は

$$F_c = B \left(\frac{\lambda}{2}\right)^2 = \frac{F_t \lambda^2}{(4\pi)^2 \Sigma_x \Sigma_{x'} \Sigma_y \Sigma_{y'}}$$
(1)

で与えられる。ここで F_t は全光束 (photons/s/0.1%b.w.) $\Sigma_{x(y)}, \Sigma_{x'(y)}$ はx(y)方向の実効光源 サイズ (mm) 及び実効角度発散 (mrad) である。 F_t はアンジュレータの仕様と蓄積電流値 で一意に決まるので、(1)式から電子ビームのエミッタンス ($\varepsilon_x \varepsilon_y$)がコヒーレントフラック スを決定していることがわかる。回折限界のビームサイズを実現するには光学素子をコヒー レントに照明する必要があるが、そのためには SPring-8 といえどもほとんどのフォトンを捨 てざるを得ない。例えば(1)式から BL24XU の 10 keV におけるコヒーレントフラックスは 6.5 × 10¹¹ photons/s/0.1%b.w. で あ り 、 こ れ は 全 光 束 F_t の わ ず か 0.04% に 過 ぎ な い ($\lambda^2/(4\pi)^2 \Sigma_x \Sigma_x \Sigma_y \Sigma_{y'} \approx 4 \times 10^{-4}$ 、すなわち 99.96%は無駄なフォトン!)。これは(1)式におい て主に $\Sigma_x と \Sigma_{x'}$ が大きい(横方向のエミッタンス ε_x が大きい)という蓄積リングの宿命のた めである。この観点から、PF が将来計画として掲げているエネルギー回収型ライナック (Energy Recovery Linac, ERL)のビーム形状が円形という特長は、マイクロビームの利用研 究にとっては、最良の選択の一つであると考えられる。

一方、光源のみならず光学素子の高度化も必須の要件である。位相 ZP では理想的な場合す



図6.Multilevel ZP(4 level の場合)の模式図.

なわち吸収がない場合の回折効率は40.5%で あるが、MZP (Multilevel zone plate)ならかな りの回折効率が期待できる。例えば、4 level なら理想的な場合(図6参照)の回折効率は 81%である。実験的には7 keV にて55%の回 折効率が達成されている[5]。ただし、これ ら電子ビームリソグラフィー法で作製され た ZP の耐熱性・耐放射線性については、 SPring-8 の分光光での実績はあるものの、よ

り高輝度のビームに対しては何らかの冷却

機構を施す必要があるかもしれない。いずれにしろ、将来のマイクロビーム研究にはまだま だ多くの R&D 要素が待ち受けていることは間違いないであろう。

謝辞

ここで述べた研究は、姫路工業大学大学院理学研究科物質科学専攻 X 線光学講座が中心に なって行ったものである。本大学院修了生である伊吹高志君、横山佳行君、在校生の新美敏 弘君、小山貴久君、和田いづみさん、講座スタッフの津坂佳幸助手、松井純爾教授に感謝し ます。また、共同研究者であり本大学院 OB でもある財団法人高輝度光科学研究センターの 高井健吾氏に感謝します。尚、毛髪断面の微量元素マッピングに関する研究は赤穂化成株式 会社との共同研究である。

参考文献

- [1] Y. Kagoshima et al., Jpn. J. Appl. Phys. 39 (2000) L433.
- [2] A. Ozawa et al., Microelectronic Engineering 35 (1997) 525.
- [3] Y. Kagoshima *et al.*, J. Synchrotron Rad. 9 (2002) 132.
- [4] Y. Suzuki et al., presented in XRM02.
- [5] E. Di Fabrizio *et al.*, Nature **401** (1999) 895.